

Judul:

Pengembangan photolithography tanpa mask dengan teknologi digital micro mirror device (DMD) dan sumber cahaya hibrida = Developing maskless photolithography process with digital micro mirror device (DMD) technology and hybrid lighting

Pengarang/Penulis:

Ignatia Averina Chita Nirmala, author

Subjek:

Photolithography; Solar energy -- Hybrid systems

Nomor Panggil:

S-Pdf

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)